日本応用磁気学会誌 24,663-666 (2000)

通電熱処理により周方向に異方性を付与したアモルファス薄帯 の磁気特性

Magnetic Characteristics of Amorphous Ribbons with Induced Anisotropy in the Circumferential Direction

高城 実・山崎二郎*

西日本工業大学電気工学科,福岡県京都郡苅田町大字新津1633(〒800-0394)

*九州工業大学工学部電気工学科,北九州市戸畑区仙水町1-1 (〒804-8550)

M. Takajo and J. Yamasaki*

Nishinippon Institute of Technology, Kanda, Fukuoka 800-0394

Kyushu Institute of Technology, Tobata, Kitakyushu 804-8550

(1999年10月28日受理, 1999年12月14日採録)

Domain and magnetic characteristics were investigated for an Fe-Co based amorphous ribbon with nearly zero magnetostriction. To induce anisotropy in the circumferential direction near the ribbon surface and in the longitudinal direction in the interior region of ribbon, the ribbon was annealed in fields applied simultaneously in the circumferential direction by a current through the ribbon and in the longitudinal direction by a solenoid. It was found that the ribbon annealed in this way exhibited the characteristics of large Barkhausen discontinuities (BHD) with a remanence ratio of 0.52 at a threshold field of about 0.5 Oe. Arc-shaped fine domains and a single domain configuration were observed near the ribbon ends and in the central region of the ribbon, respectively. It is expected that the ribbon has a similar domain configuration, consisting of core and shell domains, to that of die-drawn Fe-based wire. It is inferred from the domain observation that the BHD can be attributed to the depinning of the pinned domain near the ribbon end.

Key words: pulse generator element, amorphous ribbon, large Barkhausen discontinuities (BHD), induced magnetostrictive anisotropy, domain structure, Kerr microscope

1. はじめに

回転液中急冷法で作製された負磁歪のCo-Si-Bアモルファ スワイヤの磁区構造は円周方向磁化成分を有するシェル磁 区(外層部)と軸方向磁化成分を有するコア磁区(内層部) からなる磁気的二重構造を有する¹⁾.また,張力下で熱処理 した正磁歪の線引Fe-Si-Bアモルファスワイヤの磁区構造は 内層部に巨大なコア磁区,外層部にはバンブー状磁区を有 する二重の磁区構造になっている²⁾.これらのワイヤでは, センサ機能に有用な大バルクハウゼン跳躍特性(BHD)を低磁 界で示す特徴を持つ.急冷法で作製した as-quenched のアモ ルファス薄帯はBHD特性は示さないが,上述したワイヤの ような磁区構造を持たせることができれば,BHD素子が作 製できる可能性がある.BHD特性を有する薄帯が得られれ ば,無電源型のパルス発生素子として,ロータリーエンコー ダや盗難防止用センサタグではセンサ素子が小さくてすみ, 比較的安価なためビデオなどのレンタル店など小型店舗に 普及している.

ここでは,外層部に周方向磁化成分をもち,内層部には軸 方向磁化成分を持つような磁区構造をアモルファス薄帯を 用いて実現するために,薄帯長手方向の磁界と通電によっ て薄帯表面を最大とする周方向磁界を適当な条件で同時に 加えながら熱処理することで磁気異方性を薄帯に誘導する ことを試みた.その結果,地磁気程度の低磁界中で磁化反転 を生じ,ジッターが小さく,発生パルス電圧が大きいBHD 素子をアモルファス薄帯を用いて実現できることを報告す る.また,このセンサ素子の臨界長ならびに磁区観察結果に ついても言及する.

2. 実験方法

実験に用いたアモルファス薄帯の組成は(Fe0.06Co0.94) 79Si2.1B18.9で飽和磁歪は零に近い値を有する.薄帯の幅は 3mm,厚み25 μ m、長さ10cmである.この試料をFig.1に 示す外側にコイルを巻いた円型熱処理炉の中で350℃,5min 大気中で熱処理を行う.このとき,ソノノイドによる薄帯長 手方向の磁界 (Hb = 5Oe)と直流通電 (Ir = 1 A)によって 試料の周方向に磁界 (Hr = 0.42Oe, Hrは薄帯中心が零で表 面が最大.ここでは,薄帯表面の値)を同時に加えながら熱 処理を施している.アモルファス薄帯はアルミ製の治具に 挟み,石英ガラス管の中に入れて通電した.試料には張力な どは印加していない.ここでは,熱処理前後の磁化曲線の測



Fig. 1 Arrangement of annealing.

定(60Hz)ならびにKerr効果偏光顕微鏡と画像処理装置を用いて磁区観察を行った.顕微鏡用カメラの出力画像に対し下向きの磁化が黒,上向きの磁化が白になるように偏光子を調整した.

3. 結果と考察

はじめに、薄帯長手方向の磁界Hbが試料の磁化曲線に及 ぼす影響を調べた.マイナーループとメジャーループの印 加磁界は上下の目盛にそれぞれ対応させている.Fig.2(a)に 示す磁化曲線のように as-quenched の薄帯は大 BHD 特性は 示さず、数Oeで飽和する軟磁気特性を有する.Fig.2(b)には 薄帯に通電せず、Hb = 5Oe のもとで、350℃、5min 熱処理 した後の磁化曲線を示す.Fig.2(a),(b)に示す2つの磁化曲線 の比較から、Hb は磁化曲線を少し立たせ、保磁力をわずか 増加させる効果を示す.このことから、Hb の効果は薄帯の 長手方向に一軸異方性を誘導していると考えられる.

一方, Hb=5Oe, Hr=0.42Oe, 350℃, 5min の条件下で熱処 理したアモルファス薄帯の磁化曲線では, Fig.2(c)に見られ るように, 飽和に要する磁界が約20Oeとなることから, 薄 帯長手方向からそれた磁気異方性が熱処理によって誘導さ れたことを示している.また,マイナーループにおいて大 BHD特性を示すことがわかる.ここで見られる負から正に わたる大きな磁化変化は2段階熱処理した磁壁ピンニング 型 BHD 素子³⁰の場合とは大きく異なり, どちらかというと



Fig. 2 Magnetization curves of a 10-cm-long amorphous ribbon (a) as-quenched and, (b) for Hb = 5 Oe, Hr = 0, and (c) for Hb = 5 Oe, Hr = 0.42 Oe.



Fig. 3 Induced pulse voltage caused by flux reversal in (a) an asquenched amorphous Fe-Si-B wire and (b) an amorphous ribbon.

円形断面を有する Fe-Si-B アモルファスワイヤ¹に近い大 BHD特性となっている.磁化反転に伴って反転する軸方向 磁化 Mr は飽和値の 52%で,磁化反転磁界 H* は 0.5Oe であ る.

BHD時に発生するパルス電圧を as-quenched の Fe-Si-B ア モルファスワイヤ(直径 125 μ m, 長さ 10cm)と比較した のがFig.3(a),(b)である. Fig.3(b)に示すアモルファス薄帯(体 積はワイヤの6.1倍)の方が同じ長さのワイヤに比べて約10 倍大きなパルス電圧を発生することがわかる.

Fig.4(a),(b)はさらにジッターを比較したもので,測定時間 は2秒間である. Fig.4(a)は幅1mm,長さ5cmの同じ組成の アモルファス薄帯を図の下に示す熱処理条件で2段階熱処 理を施したもので,Fig.4(b)は薄帯に通電した場合である. 両者の比較から,今回新たに得られたアモルファス薄帯の 方が,ジッターが大幅に改善されていることがわかる.



Fig. 4 Comparison of the jitter in two-stage heat treatment of (a) the amorphous ribbon and (b) an amorphous ribbon.

日本応用磁気学会誌 Vol. 24, No. 4-2, 2000





500 /L m

(b) After flux reversal (free surface)

Fig. 5 Change in domain patterns near the ribbon end caused by BHD in Fig. 2(c).

Fig.5 は熱処理した薄帯エンド部の BHD 前後における磁 区パターンの変化を縦Kerr効果偏光顕微鏡で観察した結果 を示す.この場合,直線偏光の入射方向は薄帯長手方向と 垂直なので,磁区のコントラストは磁化が上下に配向する ほど強くなる.ここでは,薄帯幅方向の上下の磁化は白と 黒の磁区に反映される.BHD特性を示す薄帯では円弧状の 白い磁区(磁区幅 50~150 μ m)が薄帯エンド部のみに見 られるのが特徴である.薄帯エンド部では反磁界が大きく 長手方向磁化が残留しており,通電熱処理によって薄帯の 表面を最大とする周方向の磁界が加わることで,磁化が薄 帯幅方向から傾くため,円弧状磁区が形成されると考えら れる.円弧状磁区は薄帯中央部に進むにつれ円弧状から直



(a) before flux reversal(free surface) $500 \,\mu$ m



(b) After flux reversal (free surface)

Fig. 6 Change in domain patterns on the free surface of the amorphous ribbon end caused by BHD in Fig. 2(c).

線状に変化するが,エンド部から6mm程度離れると白い 磁区は消失し,黒の単磁区状磁区パターンのみになる.こ れらの円弧状磁区は磁化反転に伴い,一瞬に白から黒の円 弧状磁区に入れ替わる様子がFig.5(a),(b)からわかるが,軸 方向磁界を±2Oc程度変化させても同じ位置にあるので, 磁壁がピンニングされ安定化されていると考えられる.

Fig.6はFig.5に示した試料を90。回転させて,磁化反転 前後での磁化パターンの変化を同様に調べた.直線偏光の 入射方向は薄帯長手方向である.エンド部に存在する円弧 状磁区は長手方向磁化成分を持つことから,磁化が幅方向 から傾きを持つことが判明した.また,円弧状磁区を除い た部分では,Fig.5(a),(b)の場合に比べて磁区コントラストが 薄いので,この部分の磁化はほとんど幅方向を向いている ことを示している.

Fig.7 は薄帯の表裏における磁化の向きを調べたもので, 薄帯の表(フリー面)と裏(ロール面)の磁区パターンを 磁化反転前後(Fig.2(c)参照) で観察したものである. 直線偏 光の入射方向は薄帯幅方向である.大BHDに伴い薄帯表面 (フリー面)では、一瞬に白から黒の単磁区パターンに変化 する. このような単磁区パターンの変化は前述したように 薄帯両エンド部から約1cm離れた領域で一斉に生じる. ロール面では Fig.7(a),(b)に示すフリー面に比べて表面が荒 らいことが確認できる.Fig.7(c),(d)はロール面で観察した磁 化反転前後の磁区パターンの変化を示す. この場合, 磁化 反転に伴い白から黒の単磁区パターンに変化している.フ リー面とロール面の磁化の方向は互いに反対であるが, ロール面を磁区観察するために, 試料を裏返す必要がある ため、磁化反転前ではフリー面と同じ白のコントラストに なっている.以上より、薄帯の表裏では磁化が互いに反対 方向で、期待したように周方向に異方性が導入されている と考えている.



(b) After flux reversal (free surface) (d) After flux reversal (roll surface)

Fig. 7 Change in domain patterns on the free and roll surfaces of the amorphous ribbon caused by BHD in Fig 2.(c).



Fig. 8 Expected domain structure model of the amorphous ribbon.

Fig.8 は BHD 特性を有する薄帯の期待される磁区構造モ デルを示した.アモルファスワイヤのように磁気的に二重 の構造をしており、薄帯中心の領域では長手方向磁化成分 を有し、フリー面とロール面における磁化はそれぞれ実線 と点線で示すようにお互いに反対で、周方向に閉磁路構造 を形成し、磁化反転に伴いクロジャーの向きおよび長手方 向の磁化の方向が入れ替わるものと推測される.

つぎに,BHD 特性を有する試料の臨界長を調べるため に,薄帯の両側から少しずつ切断した後に磁化曲線を測定 した結果,長さ9 cm まではBHD 特性が保たれることがわ かった.すなわち,薄帯エンド部に存在する円弧状磁区を 削除するとBHD特性は消失する.BHD特性の消失した薄帯 を磁区観察するため,BHD特性を示すアモルファス薄帯を 両側から3cmずつ切断して残った長さ4 cmの薄帯の磁化曲 線とその薄帯エンド部の正の残留磁化状態の磁区パターン を Fig.9 に示す.直線偏光の入射方向は薄帯幅方向である. 試料の長さが短くなると,反磁界の影響でFig.9(a)に示すマ イナーループに見られるように,磁化曲線がねてしまうと ともに BHD 特性は分割され局部的に生じるようになるの で,大きなパルス電圧は誘起されない⁴.長さ4 cmの薄帯



Fig. 9 (a) Magnetization curve and the (b) domain pattern of near the ribbon end for a 4-cm-long amorphous ribbon in the positive remanent magnetization state.

エンド部では円弧状磁区は見られず,幅方向から約30°傾 いた白い磁区が観察される.白と黒の磁区はヘッドオンの 状態となっており,その境界部ではジグザグ磁区が観察さ れることからも伺い知れる.これらの磁区はピンニングさ れておらず,わずかな軸方向磁界の印加で容易に磁壁移動 を生じるため,大BHD特性は示さない.

4. まとめ

(1)アモルファス薄帯を用いて長手方向に磁界を印加し,直 流通電しながら熱処理を施すことで負磁歪のCo-Si-Bワイヤ のような BHD 特性を示すパルス発生素子が作製できる. (2)BHD特性を示す薄帯では外層部では磁化が周方向を向い た単磁区パターンで,内層部では軸方向の磁化を持つ.ま た,エンド部にはピンニングされた円弧状の磁区が存在す るが,円弧状磁区を削除するとBHD特性は消失する.

丁丁

- M.Takajo, J.Yamasaki and F.B.Humphrey:"Domain Observations of Fe and Co Based Amorphous Wires", *IEEE Trans Magn.*, 29, 6, 3484(1993)
- (2) M.Soeda, M.Takajo, J.Yamasaki and F.B.Humphrey:"Large Barkhausen Discontinuities of Die-Drawn Fe-Si-B Amorphous Wire", *IEEE Trans Magn.*, **31**, 6, 3877(1995)
- (3) 迫越友裕, 森川真伸, 山崎二郎:日本応用磁気学会講演 概要集, 26aB-3 (1995)
- (4) J.Yamasaki, M.Takajo and F.B.Humphrey: "Mechanism of Re-Entrant Flux Reversal in Fe-Si-B Amorphous Wires", *IEEE Trans Magn.*, 29, 6, 2545(1993)